

開放機器利用のご案内

地方独立行政法人山口県産業技術センターでは、各種の試験・計測機器を はじめとする多くの研究機器を保有しております。

企業の皆様に開放しておりますので、自社製品の品質管理や製品開発等に 幅広くご活用していただけます。どうぞお気軽にご利用ください。

利用機器

裏面に定める機器を予約制で利用できます。()印の機器につきましては施設外へ持ち出して使用することも可能です。

利用日時

利用日は、月曜日から金曜日までです。(祝日及び年末年始の休日を除く。)

利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。ただし、あらかじめ時間外のご利用の申し出がある場合には、午後9時まで利用が可能です。

利用手続

- 1 事前に利用の予約をお願いします。
- 2 予約は、下記問い合わせ先まで、電話、電子メール等でお願いします。
- 3 ご利用当日は、はじめに1階情報ステーション内の開放機器受付までお越しください。

機器の利用については、あらかじめ使用方法、試料形状、必要な消耗品等について担当職員と打合せをしてください。

費用

機器毎に裏面に記載の使用料を納入していただきます。

現金または口座振込により納入していただきます。口座振込の場合は請求書を送付します。振込手数料はご負担していただきます。

施設外へ持ち出して使用(()印の機器が対象)される場合は、1日単位で貸出いたします。その場合の使用料は1日8時間として計算します。運搬費等別途費用が発生する場合があります。

新事業創造支援センターに入居されている方には減免措置があります。

県外企業の方は使用料が2倍となります。

利用上の注意

利用者は、職員の指示や機器の注意事項を守って機器をご使用ください。

機器の操作方法など、不明の点は職員まで申し出て〈ださい。必要に応じ、職員が指導いたします。利用者の過失により施設又は機材器具を損傷・亡失したときは、利用者の負担において補てん、修理、又

は金銭でもって損害を弁償していただくことになりますので、注意して使用していただくようお願いします。使用終了後は、職員の確認を受けてください。

お問い合わせ先

地方独立行政法人 山口県産業技術センター 企業支援部

技術相談室(0836-53-5053)又は各担当グループ(電話番号は裏面をご参照下さい。)

E-mail:soudan@iti-yamaguchi.or.jp URL:http://www.iti-yamaguchi.or.jp/

開放機器一覧 平成23年10月1日現在

番号	機器名称	単位	使用料
加コ	- 技術グループ(0836-53-5054)		
1	アコースティックエミッション解析装置	時間	350
2	位相ドップラー式粒子測定装置	時間	
3	X線CT装置	時間	2,020
4	音響パワーレベル測定システム	時間	530
5	形彫り放電加工機	時間	710
6	CAMシステム	時間	570
7	携行型赤外線映像装置(※)	問部	410
8	高精度三次元測定機	問部	
9	高精度表面粗さ形状測定機	時間	
10	高速度ビデオカメラ(※)	問網	
11	ファイバースコープ(※)	時間	
12	真円度測定機	問網	
13	ステップゲージ(※)		810
14	精密平面研削盤	時間	
15	赤外線検知式温度計(※)	時間	
16	切削動力計(※)	時間	
17	旋盤	時間	530
18	騒音計(※)	時間	430
19	測定顕微鏡	時間	
20	立形マシニングセンター		1,030
21	超音波顕微鏡	時間	
22	長距離顕微鏡(※)		330
23	データロガー(※)	H	780
24	抵抗計(※)	時間	
25	ハイスピードミーリングセンター	時間	1,420
26	万能材料試験機	時間	1,300
27	反発式ポータブル硬度計(※)	問部	400
28	微小硬度計	時間	
29	ビッカース硬度計	時間	
30	ビデオプローブ式三次元測定機	時間	
31	使進温度計(※)	問制	
32	フライス盤	時間	
33	ブリネル硬度計	問制	
34	ブロックゲージ	問制	
35		時間	-
36	細穴放電加工機	問部	
37	マイクロ波透過式水分計(※)	時間	
38	マイクロ放送過式水力計(次) 無響室	問部	
39	ラップ盤	時間	
40	フック盤 レーザー干渉平面度測定装置		930
41	ロックウェル硬さ試験機	時間	
		時間	
42	露点計		
43	ワイヤー放電加工機	메미	1,090
=n=	上生 4川		
	十制御グループ(0836-53-5055)	n±88	250
44	FFTアナライザー(※)	時間	350

表几条	L生l体I f i l - プ(0000 E0 E0EE)		
	制御グループ(0836-53-5055)		
44	FFTアナライザー(※)	時間	350
45	LCRメータ(※)	時間	370
46	オシロスコープ(※)	時間	330
47	簡易ノイズ測定機(※)	時間	330
48	機械設計支援システム	時間	550
49	クランプ電力計(※)	時間	360
50	振動測定装置(※)	時間	420
51	スペクトラム・インピーダンスアナライザー(※)	時間	510
52	制御系設計支援システム	時間	550
53	生体信号計測装置(※)	時間	350
54	体圧分布測定器	時間	590
55	低抵抗率計(※)	時間	350
56	電子回路基板加工機	時間	550
57	電子負荷装置(※)	時間	350
58	任意波形発生器(※)	時間	350
59	ひずみ測定機(※)	時間	400
60	標準電圧電流発生装置(※)	時間	360
61	表面実装装置	時間	480
62	マルチメーター(※)	時間	330
63	ミックスド・シグナル・オシロスコープ(※)	時間	440
64	リアルタイムスペクトラムアナライザー	時間	500
65	レーザー式運動精度測定装置(※)	時間	410
66	レーザードップラー式振動計(※)	時間	480
67	ロジックアナライザー	時間	330

電子	そ応用グループ(0836-53-5056)		
68	エリプソメーター	時間	540
69	雷サージ耐性試験機	時間	470
70	干渉膜厚計	時間	840
71	輝度・照度自動マッピング測定装置	時間	570
72	射出成形機(横型)	時間	830
73	照度マッピング測定装置	時間	550
74	静電気耐性試験機	時間	460
75	電源電圧変動耐性試験機	時間	460
76	電磁干渉試験機(エミッション)	時間	870
77	電磁耐性試験機(イミュニティ)	時間	750

番号	機器名称	単位	使用料		
78	電波暗室	時間	2,940		
79	配光測定装置	晶	440		
80	光スペクトラムアナライザー	晶	1,070		
81	ファーストトランジェント・バースト耐性試験機	晶	460		
82	複合環境試験機(振動試験機・恒温槽同時使用)	晶	1,150		
83	複合環境試験機(振動試験機)	晶晶	770		
84	複合環境試験機(恒温槽)	晶	380		
85	分光放射輝度計	晶	420		
86	マイクロハイスコープシステム	時間	380		
材料	材料技術グループ(0836-53-5057)				

87 イオンミリング装置 時間 1,200 88 X線応力測定装置 時間 550 89 X線に対談装置 時間 2,390 90 往復運動平面摩耗試験機 時間 390 91 力ス置換式高速昇温加熱炉 日 1,810 92 カラーレーザー顕微鏡 時間 350 93 金属研磨装置 時間 540 95 原子間力顕微鏡 時間 540 96 原子吸光分光光度計 時間 460 97 硬質皮膜密着度試験機 時間 450 98 高真空・雰囲気式管状炉 日 1,980 99 高精度研磨装置 時間 490 100 小型のっき装置 日 1,980 101 紫外・可視分光光度計 時間 480 102 磁気応力測定装置 日 1,410 101 紫外・可視分光光度計 時間 480 102 磁気応力測定装置 (※) 時間 350 103 試験片加工機 時間 450 104 実体顕鏡鏡 時間 450 105 自動分極装置 時間 610 106 自動分極装置 時間 670 107 触針式表面形状測定機 時間 380 108 真空蒸着装置 時間 670 107 触針式表面形状测定機 時間 1,670 110 精密スリット加工機 時間 670 111 活外線映像装置 時間 690 112 接触角計 時間 420 113 走査型オージェ電子顕微鏡 時間 1,670 114 超微小押込み硬さ試験機 時間 1,670 115 定温乾燥機 時間 1,670 116 低質空走査電子顕微鏡 時間 1,670 117 デジタルマイクロアナライザー 時間 430 115 定温乾燥機 時間 1,670 116 優立上産産産子顕微鏡 時間 1,670 117 デジタルマイクロアナライザー 時間 770 123 粘弾性測定装置 時間 500 118 電子線マイクロアナライザー 時間 770 123 粘弾性測定装置 時間 500 124 薄膜用摩擦摩耗試験機 時間 360 125 破心が接置 日 7,860 127 引張圧縮試験機 時間 550 128 カイールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 550 129 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 500 121 熱分析装置(ICSC) 時間 680 122 熱分析装置(ICSC) 時間 770 123 粘弾性測定装置 時間 500 124 薄膜用摩擦摩耗試験機 時間 360 125 破心が機 時間 550 126 破心が機 時間 550 127 可以が表質 日 7,860 128 カイールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 550 129 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 550 131 複合サイクル試験機 時間 550 132 ブラズマ化学蒸着装置 日 7,860 133 溶射皮膜摩耗試験機 時間 550 134 摩擦摩耗試験機 時間 550 135 溶射皮膜摩耗試験機 時間 550 136 溶射皮膜摩耗試験機 時間 500 137 アイルドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 550 138 アイルドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 500 139 溶射皮膜変積 時間 500 131 溶射皮膜変積 時間 500 132 アイルドエミッションオージェ電が開始 500 133 が電力・ブマルド・ブー・対対が関帯 500 134 摩擦摩耗試験機 時間 520		¥技術グループ(0836-53-505/)		
89	87		晶	1,200
89	88	X線応力測定装置	時間	550
90 往復運動平面摩耗試験機 時間 390 91 ガス置換式高速昇温加熱炉 日 1,810 92 カラーレーザー顕微鏡 時間 880 93 金属研磨装置 時間 540 95 原子間力顕微鏡 時間 540 95 原子間力顕微鏡 時間 530 96 原子吸光分光光度計 時間 460 97 硬質皮膜密着度試験機 時間 450 98 高真空・雰囲気式管状炉 日 1,980 99 高精度研磨装置 時間 490 100 小型めっき装置 日 1,410 101 紫外・可視分光光度計 時間 480 102 磁気応力測定装置 (※) 時間 350 103 試験片加工機 時間 460 104 実体顕微鏡 時間 420 105 自動分破鏡 時間 420 106 創出成形機(縦型) 時間 670 107 触針式表面形状測定機 時間 380 108 真空蒸着装置 時間 690 109 スパッタリング装置 日 10,330 110 精密スリット加工機 時間 480 111 赤外線映像装置 時間 490 112 接触角計 時間 420 113 走査型オージェ電子顕微鏡 時間 420 114 超微小押込み硬さ試験機 時間 1,670 114 超微小押込み硬さ試験機 時間 1,670 114 超微小押込み硬さ試験機 時間 1,190 115 定温乾燥 時間 410 116 低真空走奮電子顕微鏡 時間 410 117 デジタルマイクロスコーブ(※) 時間 500 118 電子線マイクロアナライザー 時間 4,340 119 倒立型金属顕微鏡 時間 360 120 ドライフィルムラミネーター 時間 510 111 赤分析装置(TS-DTA) 時間 500 112 熱分析装置(TS-DTA) 時間 500 112 薄膜用摩擦摩耗試験機 時間 520 122 熱分析装置(TS-DTA) 時間 520 124 薄膜用摩擦摩耗試験機 時間 520 125 破砕機 時間 520 126 反応スパッタリング装置 日 7,860 127 引張圧縮試験機 時間 520 128 カイ・ルドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 520 129 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 520 121 薄膜用摩擦摩耗試験機 時間 520 122 対分状装置 日 7,860 123 が選上圧縮試験機 時間 520 124 薄膜用摩擦摩耗試験機 時間 520 125 破砕機 時間 520 127 可以工変換赤外分光光度計 時間 610 131 複合サイクル試験機 日 2,720 132 ブラズマ化学蒸着装置 日 3,260 133 次電プラズマ快差素	89		時間	2.390
1 カス置換式高速昇温加熱炉 日 1,810 1 カラーレーザー顕微鏡 時間 350 3 金属研磨装置 時間 540 9	90	往復運動平面摩耗試験機		
92 カラーレーザー顕微鏡 時間 350 3 金属研磨装置 時間 350 540 蛍光X線膜厚計 時間 540 550 原子間み微鏡 時間 460 97 硬質皮膜密着皮試験機 時間 450 98 高真空・雰囲気式管状炉 日 1,980 99 高精度研磨装置 日 1,980 100 小型めっき装置 日 1,410 101 紫外・可視分光光度計 時間 450 480 102 磁気応力測定装置 日 1,410 101 紫外・可視分光光度計 時間 460 102 磁気応力測定装置 日 1,410 101 紫外・可視分光光度計 時間 460 102 磁気応力測定装置 時間 460 103 試験片加工機 時間 420 105 自動分極装置 時間 670 107 107 107 107 108 108 真空落著装置 時間 670 109 スパッタリング装置 日 10,330 110 精密スリット加工機 時間 480 111 赤外線映像装置 時間 480 111 赤外線映像装置 時間 480 111 赤外線映像装置 時間 480 112 接触角計 日間 420 113 走査型オージェ電子顕微鏡 時間 410 116 低真空走査電子顕微鏡 時間 410 117 デジタルマイクロアナライザー 時間 4,340 119 117 デジタルマイクロアナライザー 時間 500 118 電子線マイクロアナライザー 時間 500 118 電子線マイクロアナライザー 時間 500 112 熱分析装置 日の公本属顕微鏡 時間 360 120 ドライフィルムラミネーター 時間 510 121 熱分析装置 日の公本属顕微鏡 時間 550 121 熱分析装置 日の公本房 121 第分析装置 日の公本房 121 131 121 131 132 132 133 135 135 137 137 138 137 137 138 139 139 130 130 131 130 131 130 131 130 131 130 131 130 131	91			
93 金属研磨装置 時間 350 94 蛍光X線膜厚計 時間 540 540 95 原子間力顕微鏡 時間 530 96 原子吸光分光光度計 時間 450 97 硬質皮膜密着度試験機 時間 450 98 高真空・雰囲気式管状炉 日 1,980 99 高精度研磨装置 日 1,980 100 小型めっき装置 日 1,410 101 紫外・可視分光光度計 時間 490 480 420 102 磁気応力測定装置(※) 時間 350 103 試験片加工機 時間 420 104 実体顕微鏡 時間 610 106 射出成形機(縦型) 時間 670 107 触針式表面形状測定機 時間 670 107 触針式表面形状測定機 時間 670 107			_	
94 蛍光X線膜厚計 時間 530 96 原子間力顕微鏡 時間 460 97 硬質皮膜密着度試験機 時間 450 98 高真空・雰囲気式管状炉 日 1,450 100 小型めっき装置 日 1,410 101 紫外・可視分光光度計 時間 480 480 102 磁気応力測定装置 日 1,410 101 紫外・可視分光光度計 時間 460 104 実体顕微鏡 時間 460 104 実体顕微鏡 時間 670 105 自動分極装置 日 10,330 106 射出成形機(縦型) 時間 670 107 触針式表面形状測定機 時間 670 107				
95 原子間力顕微鏡 時間 530 96 原子吸光分光光度計 時間 460 97 硬質皮膜密蓍度試験機 時間 450 99 高暮度研磨装置 時間 490 1,980 1,000 小型めっき装置 日 1,410 1,410 1,410 1,530 1,5				
96				
97 硬質皮膜密着度試験機 時間 450 98 高真空・雰囲気式管状炉 日 1,980 99 高精度研磨装置 日 1,410 100 小型めっき装置 日 1,410 磁気応力測定装置(※) 時間 480 46				
98 高真空・雰囲気式管状炉 日 1,980 99 高精度研磨装置				
99 高精度研磨装置 日				
100 小型のっき装置	98			
101 紫外・可視分光光度計 時間 480 48		131024711024	時間	
102 磁気応力測定装置(※) 時間 350 103 試験片加工機 時間 420 105 自動分極装置 時間 610 610 106 射出成形機(縦型) 時間 670 107 触針式表面形状測定機 時間 690 108 真空蒸着装置 時間 690 109 スパッタリング装置 日 10,330 110 精密スリット加工機 時間 480 111 赤外線映像装置 時間 420 111 赤外線映像装置 時間 420 113 走査型オージェ電子顕微鏡 時間 420 114 超微小押込み硬さ試験機 時間 630 115 定温乾燥機 時間 410 116 低真空走査電子顕微鏡 時間 4,10 117 デジタルマイクロスコープ(※) 時間 4,340 118 電子線マイクロアナライザー 時間 4,340 119 倒立型金属顕微鏡 時間 3,60 120 ドライフィルムラミネーター 時間 510 121 熱分析装置(DSC) 時間 510 121 熱分析装置(TS-DTA) 時間 520 121 熱分析装置(TS-DTA) 時間 520 122 熱分析装置(TS-DTA) 時間 550 125 破砕機 時間 550 126 反応スパッタリング装置 日 7,860 127 引張圧縮試験機 時間 550 128 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 時間 550 129 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 550 129 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 550 129 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 550 129 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 550 129 フィールドエミッション大変重要 130 フリエ変換赤外分光光度計 131 複合サイクル試験機 日 2,720 132 プラズマ化学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 2,380 134 摩擦摩耗試験機 時間 2,380 135 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 1,000 137 メルトインデクサー 時間 1,000 137 メルトインデクサー 時間 1,000 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 2,260 139 溶射皮膜摩耗試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 1,060 141 ラマン分光光度計	100	小型めっき装置	\Box	1,410
103 試験片加工機 時間 420 420 105 自動分極装置 時間 610 610 610 9加水形機(縦型) 時間 670 107 触針式表面形状測定機 時間 630 108 真空落去装置 時間 630 108 真空落去装置 時間 480 111 赤外線映像装置 時間 480 111 赤外線映像装置 時間 420 113 走査型オージェ電子顕微鏡 時間 420 114 超微小押込み硬さ試験機 時間 630 115 定温乾燥機 時間 410 116 低真空走査電子顕微鏡 時間 1,670 114 超微小押込み硬さ試験機 時間 1,190 117 デジタルマイクロスコープ(※) 時間 4,30 115 定温乾燥機 時間 4,10 116 低真空走査電子顕微鏡 時間 4,30 118 電子線マイクロスコープ(※) 時間 500 118 電子線マイクロスコープ(※) 時間 4,340 119 倒立型金属顕微鏡 時間 3,60 120 ドライフィルムラミネーター 時間 3,60 121 熱分析装置(Tg-DTA) 時間 520 121 熱分析装置(Tg-DTA) 時間 520 122 熱分析装置(Tg-DTA) 時間 550 125 破砕機 時間 550 125 破砕機 時間 550 126 反応スパッタリング装置 日 7,860 127 31張圧縮試験機 時間 550 128 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 時間 5,50 129 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 550 129 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 550 129 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 日 7,860 131 複合サイクル試験機 日 2,720 132 プラズマ化学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 2,380 134 摩擦摩耗試験機 時間 5,20 135 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 1,000 137 メルトインデクサー 時間 1,000 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 2,260 139 溶射皮膜摩耗試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 1,060 141 ラマン分光光度計	101	紫外・可視分光光度計	時間	480
103 試験片加工機 時間 420 420 105 自動分極装置 時間 610 610 610 9加水形機(縦型) 時間 670 107 触針式表面形状測定機 時間 630 108 真空落去装置 時間 630 108 真空落去装置 時間 480 111 赤外線映像装置 時間 480 111 赤外線映像装置 時間 420 113 走査型オージェ電子顕微鏡 時間 420 114 超微小押込み硬さ試験機 時間 630 115 定温乾燥機 時間 410 116 低真空走査電子顕微鏡 時間 1,670 114 超微小押込み硬さ試験機 時間 1,190 117 デジタルマイクロスコープ(※) 時間 4,30 115 定温乾燥機 時間 4,10 116 低真空走査電子顕微鏡 時間 4,30 118 電子線マイクロスコープ(※) 時間 500 118 電子線マイクロスコープ(※) 時間 4,340 119 倒立型金属顕微鏡 時間 3,60 120 ドライフィルムラミネーター 時間 3,60 121 熱分析装置(Tg-DTA) 時間 520 121 熱分析装置(Tg-DTA) 時間 520 122 熱分析装置(Tg-DTA) 時間 550 125 破砕機 時間 550 125 破砕機 時間 550 126 反応スパッタリング装置 日 7,860 127 31張圧縮試験機 時間 550 128 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 時間 5,50 129 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 550 129 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 550 129 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 日 7,860 131 複合サイクル試験機 日 2,720 132 プラズマ化学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 2,380 134 摩擦摩耗試験機 時間 5,20 135 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 1,000 137 メルトインデクサー 時間 1,000 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 2,260 139 溶射皮膜摩耗試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 1,060 141 ラマン分光光度計	102	磁気応力測定装置(※)	時間	350
105 自動分極装置 時間 670 670 107 触針式表面形状測定機 時間 690 109 スパッタリング装置 日 10,330 110 精密スリット加工機 時間 480 111 赤外線映像装置 時間 420 113 走査型オージェ電子顕微鏡 時間 1,670 114 超微小押込み硬さ試験機 時間 1,190 116 低真空走査電子顕微鏡 時間 1,190 117 デジタルマイクロスコープ(※) 時間 500 118 電子線マイクロアナライザー 時間 4,340 119 倒立型金属顕微鏡 時間 510 118 電子線マイクロアナライザー 時間 510 121 熱分析装置(DSC) 時間 510 121 熱分析装置(DSC) 時間 520 122 熱分析装置(DSC) 時間 520 124 薄膜用摩擦摩耗試験機 時間 550 125 破砕機 126 反応スパッタリング装置 日 7,860 127 引張圧縮試験機 時間 550 128 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 時間 550 127 可張正緒試験機 時間 550 128 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 5,50 129 フィールドエミッション大査電子顕微鏡 時間 2,420 130 フーリエ変換赤外分光光度計 時間 610 131 複合サイクル試験機 日 2,720 132 ブラズマ佐学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 3,90 135 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 520 137 メルトインデクサー 時間 520 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 520 139 溶射皮膜密着力試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 1,060 141 ラマン分光光度計 時間 1,060 141 ラマン分光光度計 時間 1,060 141 ラマン分光光度計				
105 自動分極装置 時間 670 670 107 触針式表面形状測定機 時間 690 109 スパッタリング装置 日 10,330 110 精密スリット加工機 時間 480 111 赤外線映像装置 時間 420 113 走査型オージェ電子顕微鏡 時間 1,670 114 超微小押込み硬さ試験機 時間 1,190 116 低真空走査電子顕微鏡 時間 1,190 117 デジタルマイクロスコープ(※) 時間 500 118 電子線マイクロアナライザー 時間 4,340 119 倒立型金属顕微鏡 時間 510 118 電子線マイクロアナライザー 時間 510 121 熱分析装置(DSC) 時間 510 121 熱分析装置(DSC) 時間 520 122 熱分析装置(DSC) 時間 520 124 薄膜用摩擦摩耗試験機 時間 550 125 破砕機 126 反応スパッタリング装置 日 7,860 127 引張圧縮試験機 時間 550 128 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 時間 550 127 可張正緒試験機 時間 550 128 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 5,50 129 フィールドエミッション大査電子顕微鏡 時間 2,420 130 フーリエ変換赤外分光光度計 時間 610 131 複合サイクル試験機 日 2,720 132 ブラズマ佐学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 3,90 135 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 520 137 メルトインデクサー 時間 520 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 520 139 溶射皮膜密着力試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 1,060 141 ラマン分光光度計 時間 1,060 141 ラマン分光光度計 時間 1,060 141 ラマン分光光度計				
106 射出成形機(縦型) 時間 670 107 触針式表面形状測定機 時間 690 109 スパッタリング装置 日 10,330 110 精密スリット加工機 時間 480 480 480 111 赤外線映像装置 時間 420				
107 触針式表面形状測定機 時間 380 108 真空蒸着装置 時間 690 690 7パッタリング装置 日 10,330 110 精密スリット加工機 時間 480 480 111 赤外線映像装置 時間 420 113 走査型オージェ電子顕微鏡 時間 1,670 114 超微小押込み硬さ試験機 時間 4,10 115 定温乾燥機 時間 4,10 116 低真空走查電子顕微鏡 時間 1,190 117 デジタルマイクロアナライザー 時間 500 118 電子線マイクロアナライザー 時間 540 119 倒立型金属顕微鏡 時間 510 121 熱分析装置(DSC) 時間 510 121 熱分析装置(DSC) 時間 520 122 熱分析装置(Tg-DTA) 時間 570 123 粘弹性測定装置 時間 520 124 薄膜用摩擦摩耗試験機 時間 550 125 破砕機 時間 560 770 123 13正縮試験機 時間 560 126 反応スパッタリング装置 日 7,860 127 31張圧縮試験機 時間 550 128 フィールドエミッション走查電子顕微鏡 時間 5,50 129 フィールドエミッション大金電子顕微鏡 時間 2,420 130 フーリエ変換赤外分光光度計 時間 6,10 131 複合サイクル試験機 日 7,20 132 プラズマ化学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 2,380 134 摩擦摩耗試験機 時間 3,90 135 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 7,30 137 メルトインデクサー 時間 7,30 137 メルトインデクサー 時間 520 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 520 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 520 139 溶射皮膜密着力試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 1,060 141 ラマン分光光度計 時間 1,060 141 ラマン分光光度計				
108 真空蒸着装置 時間 690 109 スパッタリング装置 日 10,330 110 精密スリット加工機 時間 480 480 111 赤外線映像装置 時間 960 112 接触角計 時間 420 日 1670 日 1670 日 1670 日 1670 日 1670 日 1770 日 17				
109 スパッタリング装置 日 10,330 110 精密スリット加工機 時間 480 480 480 111 赤外線映像装置 時間 420 420 113 走査型オージェ電子顕微鏡 時間 1,670 114 超微小押込み硬さ試験機 時間 4,10 115 定温乾燥機 時間 4,10 117 デシタルマイクロスコープ(※) 時間 5,00 118 電子線マイクロアナライザー 時間 4,340 119 倒立型金属顕微鏡 時間 5,00 120 ドライフィルムラミネーター 時間 5,10 121 熱分析装置(DSC) 時間 5,10 121 熱分析装置(DSC) 時間 5,10 122 熱分析装置(Tg-DTA) 時間 5,10 123 粘弾性測定装置 時間 5,20 124 薄膜用摩擦摩耗試験機 時間 5,50 125 破砕機 時間 5,50 127 3]張圧縮試験機 時間 5,50 128 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 時間 5,50 129 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 時間 2,530 129 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 2,530 129 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 2,530 129 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 2,380 131 複合サイクル試験機 日 3,260 132 プラズマ化学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 2,380 134 摩擦摩耗試験機 時間 3,90 135 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 5,20 137 メルトインデクサー 時間 1,000 137 メルトインデクサー 時間 5,20 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 5,20 139 溶射皮膜密着力試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 1,060 141 ラマン分光光度計 時間 1,060 141 ラマン分光光度計 時間 1,060 141 ラマン分光光度計				
110 精密スリット加工機 時間 480 480 480 111 赤外線映像装置 時間 960 112 接触角計 時間 420 113 走査型オージェ電子顕微鏡 時間 1,670 114 超微小押込み硬さ試験機 時間 630 115 定温乾燥機 時間 4,10 116 佐真空走査電子顕微鏡 時間 1,190 117 デジタルマイクロアナライザー 時間 4,340 118 電子線マイクロアナライザー 時間 4,340 119 倒立型金属顕微鏡 時間 360 120 ドライフィルムラミネーター 時間 510 121 熱分析装置(DSC) 時間 680 122 熱分析装置(Tg-DTA) 時間 570 123 粘弾性測定装置 時間 520 124 薄膜用摩擦摩耗試験機 時間 550 125 破砕機 時間 550 126 反応スパッタリング装置 日 7,860 127 引張圧縮試験機 時間 550 128 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 時間 550 129 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 日 7,860 129 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 日 7,860 129 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 日 2,420 130 フーリエ変換赤外分光光度計 時間 610 131 複合サイクル試験機 日 2,720 132 プラズマ化学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 2,380 135 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 730 137 メルトインデクサー 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 520 139 溶射皮膜摩耗試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 1,060 141 ラマン分光光度計				
111 赤外線映像装置 時間 960 112 接触角計 時間 420 113 走査型オージェ電子顕微鏡 時間 1,670 114 超微小押込み硬さ試験機 時間 630 115 定温乾燥機 時間 4,10 116 低真空走査電子顕微鏡 時間 1,190 117 デジタルマイクロスコープ(※) 時間 500 18 電子線マイクロアナライザー 時間 360 120 ドライフィルムラミネーター 時間 510 121 熱分析装置(DSC) 時間 510 121 熱分析装置(Tg-DTA) 時間 770 123 粘弾性測定装置 時間 520 124 薄膜用摩擦摩耗試験機 時間 550 125 破砕機 時間 550 126 反応スパッタリング装置 日 7,860 127 引張圧縮試験機 時間 550 128 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 時間 550 129 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 時間 2,420 130 フーリエ変換赤外分光光度計 時間 610 131 複合サイクル試験機 日 2,720 132 プラズマ化学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 3,90 135 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 1,000 137 メルトインデクサー 時間 1,000 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 520 139 溶射皮膜摩耗試験機 時間 330 140 溶射皮膜摩耗試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜磨着力試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 1,060 141 ラマン分光光度計 時間 1,060 141 ラマン分光光度計 時間 1,060 141 ラマン分光光度計				
112 接触角計 時間 420 113 走査型オージェ電子顕微鏡 時間 1,670 114 超微小押込み硬さ試験機 時間 410 115 定温乾燥機 時間 1,190 117 デジタルマイクロスコープ(※) 時間 500 118 電子線マイクロスコープ(※) 時間 360 118 電子線マイクロスコープ(※) 時間 360 119 倒立型金属弧微鏡 時間 360 120 ドライフィルムラミネーター 時間 510 121 熱分析装置(DSC) 時間 680 122 熱分析装置(Tg-DTA) 時間 770 123 粘弾性測定装置 時間 520 124 薄膜用摩擦摩耗試験機 時間 550 125 破砕機 時間 550 126 反応スパッタリング装置 日 7,860 127 31張圧縮試験機 時間 2,530 128 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 時間 2,530 128 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 日 7,860 129 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 時間 2,530 129 フィールドエミッション大産電子顕微鏡 日 2,720 131 複合サイクル試験機 日 2,720 132 プラズマ化学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 3,90 135 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 730 137 メルトインデクサー 時間 730 137 メルトインデクサー 時間 730 137 メルトインデクサー 時間 730 137 郊射皮膜摩耗試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜摩耗試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜摩耗試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜摩耗試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜摩耗試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜変積力試験機 時間 1,060 141 ラマン分光光度計 時間 1,060 141 ラマン分光光度計				
113 走査型オージェ電子顕微鏡 時間 1,670 114 超微小押込み硬さ試験機 時間 630 115 定温乾燥機 時間 410 116 低真空走査電子顕微鏡 時間 1,190 117 デジタルマイクロスコープ(※) 時間 500 118 電子線マイクロアナライザー 時間 4,340 119 倒立型金属顕微鏡 時間 560 120 ドライフィルムラミネーター 時間 510 511 熱分析装置 (DSC) 時間 680 121 熱分析装置 (DSC) 時間 770 123 粘弾性測定装置 時間 520 124 薄膜用摩擦摩耗試験機 時間 520 124 薄膜用摩擦摩耗試験機 時間 550 125 破砕機 126 反応スパッタリング装置 日 7,860 127 引張圧縮試験機 時間 2,530 128 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 2,530 129 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 2,530 129 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 2,530 129 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 2,420 131 複合サイクル試験機 日 2,720 132 プラズマ化学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 3,90 135 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 730 137 メルトインデクサー 時間 730 137 メルトインデクサー 時間 7,00 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 2,260 139 溶射皮膜摩耗試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 3,00 141 ラマン分光光度計 時間 1,060 141 ラマン分光光度計 時間 1,060				
114 超微小押込み硬さ試験機 時間 630 6				
115 定温乾燥機 時間 410 116 低真空走査電子顕微鏡 時間 1,190 117 デジタルマイクロスコープ(※) 時間 500 118 電子線マイクロアナライザー 時間 4,340 119 倒立型金属顕微鏡 時間 510 510 121 熱分析装置(DSC) 時間 680 122 熱分析装置(TS-DTA) 時間 770 123 粘弾性測定装置 時間 520 124 薄膜用摩擦摩耗試験機 時間 550 125 破砕機 時間 550 126 反応スパッタリング装置 日 7,860 126 反応スパッタリング装置 日 7,860 127 引張圧縮試験機 時間 8,50 128 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 時間 2,420 130 フーリエ変換赤外分光光度計 時間 6,10 131 複合サイクル試験機 日 2,720 132 ブラズマ佐学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ佐学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 2,380 134 摩擦摩耗試験機 時間 3,90 135 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 5,20 137 メルトインデクサー 時間 5,260 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 5,260 139 溶射皮膜密着力試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 4,60 141 ラマン分光光度計 時間 1,060	113	走査型オージェ電子顕微鏡		
116 低真空走査電子顕微鏡 時間 1,190 117 デジタルマイクロスコープ(※) 時間 500 118 電子線マイクロアナライザー 時間 4,340 119 倒立型金属顕微鏡 時間 510 510 121 熱分析装置(DSC) 時間 680 122 熱分析装置(Tg-DTA) 時間 770 123 粘弾性測定装置 時間 520 124 薄膜用摩擦摩耗試験機 時間 550 125 破砕機 126 反応スパッタリング装置 日 7,860 127 引張圧縮試験機 時間 850 128 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 時間 2,530 129 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 2,420 130 フーリエ変換赤外分光光度計 時間 610 131 複合サイクル試験機 日 2,720 132 ブラズマ化学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 3,30 135 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 7,30 137 メルトインデクサー 時間 520 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 520 139 溶射皮膜摩耗試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 1,060 141 ラマン分光光度計 時間 1,060	114	超微小押込み硬さ試験機		
117	115	定温乾燥機	時間	410
117	116	低真空走查電子顕微鏡	時間	1,190
118 電子線マイクロアナライザー 時間 4,340 119 倒立型金属顕微鏡 時間 360 120 ドライフィルムラミネーター 時間 510 121 熱分析装置 (DSC) 時間 680 770 123 熱分析装置 (Tg-DTA) 時間 520 124 薄膜用摩擦摩耗試験機 時間 550 125 破砕機 126 反応スパッタリング装置 日 7,860 127 引張圧縮試験機 時間 850 128 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 2,530 129 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 2,420 130 フーリエ変換赤外分光光度計 時間 610 131 複合サイクル試験機 日 2,720 132 ブラズマ化学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 2,380 134 摩擦摩耗試験機 時間 3,90 135 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 730 137 メルトインデクサー 時間 520 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 520 139 溶射皮膜密着力試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 4,60 141 ラマン分光光度計 時間 1,060		デジタルマイクロスコープ(※)	時間	500
119 倒立型金属顕微鏡 時間 360 360 360 770 770 770 121 熱分析装置 (DSC) 時間 510 770	118		時間	4.340
120 ドライフィルムラミネーター 時間 510 121 熱分析装置 (DSC) 時間 680				
121 熱分析装置(DSC) 時間 680 68				
122 熱分析装置(Tg-DTA) 時間 770 123 粘弾性測定装置 時間 520 124 薄膜用摩擦摩耗試験機 時間 550 125 破砕機 時間 560 7,860 日 2,530 日 2,760 日 2,760 日 2,760 日 3,260 日				
123 粘弾性測定装置 時間 520 520 124 薄膜用摩擦摩耗試験機 時間 550 125 破砕機 時間 560 7,860 126 反応スパッタリング装置 日 7,860 127 引張圧縮試験機 時間 850 128 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 時間 2,530 129 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 2,420 130 フーリエ変換赤外分光光度計 時間 610 131 複合サイクル試験機 日 2,720 132 プラズマ化学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 2,380 134 摩擦摩耗試験機 時間 3,90 135 マスクアライナー 時間 730 136 ミクロトーム 時間 730 137 メルトインデクサー 時間 730 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 520 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 520 139 溶射皮膜密着力試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 460 141 ラマン分光光度計 時間 1,060				
124 薄膜用摩擦摩耗試験機 時間 550 125 破砕機 時間 560 7,860 126 反応スパッタリング装置 日 7,860 127 引張圧縮試験機 時間 850 128 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 時間 2,530 129 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 2,420 130 フーリエ変換赤外分光光度計 時間 610 131 複合サイクル試験機 日 2,720 132 プラズマ化学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 2,380 134 摩擦摩耗試験機 時間 3,90 135 マスクアライナー 時間 7,30 136 ミクロトーム 時間 7,30 137 メルトインデクサー 時間 7,00 136 ミクロトーム 137 メルトインデクサー 時間 5,20 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 5,20 139 溶射皮膜摩耗試験機 時間 3,30 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 4,60 141 ラマン分光光度計 時間 1,060				
125 破砕機 時間 560 126 反応スパッタリング装置 日 7,860 127 引張圧縮試験機 時間 850 128 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 時間 2,530 129 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 2,420 130 フーリエ変換赤外分光光度計 時間 610 131 複合サイクル試験機 日 2,720 132 プラズマ化学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 2,380 134 摩擦摩耗試験機 時間 3,90 135 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 730 136 ミクロトーム 時間 520 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 5,260 139 溶射皮膜摩耗試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 460 141 ラマン分光光度計 時間 1,060				
126 反応スパッタリング装置 日 7,860 127 引張圧縮試験機 時間 2,530 128 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 時間 2,530 129 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 2,420 130 フーリエ変換赤外分光光度計 時間 610 131 複合サイクル試験機 日 2,720 132 プラズマ化学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 2,380 134 摩擦摩耗試験機 時間 390 135 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 730 137 メルトインデクサー 時間 730 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 520 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 2,260 139 溶射皮膜摩耗試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 460 141 ラマン分光光度計 時間 1,060			5	
127 引張圧縮試験機 時間 850 128 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 時間 2,530 129 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 2,420 130 フーリエ変換赤外分光光度計 時間 610 131 複合サイクル試験機 日 2,720 132 プラズマ化学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 2,380 134 摩擦摩耗試験機 時間 3,90 135 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 730 137 メルトインデクサー 時間 730 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 2,260 139 溶射皮膜摩耗試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 460 141 ラマン分光光度計 時間 1,060	_			
128 フィールドエミッション走査電子顕微鏡 時間 2,530 129 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 2,420 130 フーリエ変換赤外分光光度計 時間 610 131 複合サイクル試験機 日 2,720 132 プラズマ化学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 2,380 134 摩擦摩耗試験機 時間 390 135 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 730 137 メルトインデクサー 時間 520 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 2,260 139 溶射皮膜摩耗試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 460 141 ラマン分光光度計 時間 1,060				
129 フィールドエミッションオージェ電子顕微鏡 時間 2,420 130 フーリエ変換赤外分光光度計 時間 610 131 複合サイクル試験機 日 2,720 132 プラズマ化学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 2,380 134 摩擦摩耗試験機 時間 390 135 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 730 137 メルトインデクサー 時間 520 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 520 139 溶射皮膜摩耗試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 460 141 ラマン分光光度計 時間 1,060			時間	850
130 フーリエ変換赤外分光光度計 時間 610 131 複合サイクル試験機 日 2,720 132 プラズマ化学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 2,380 134 摩擦摩耗試験機 時間 390 135 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 730 137 メルトインデクサー 時間 520 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 2,260 139 溶射皮膜摩耗試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 460 141 ラマン分光光度計 時間 1,060	_			
131 複合サイクル試験機 日 2,720 132 プラズマ化学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 2,380 134 摩擦摩耗試験機 時間 1,000 135 マスクアライナー 時間 730 136 ミクロトーム 時間 520 137 メルトインデクサー 時間 520 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 2,260 139 溶射皮膜摩耗試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 460 141 ラマン分光光度計 時間 1,060				
132 プラズマ化学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 2,380 134 摩擦摩耗試験機 時間 390 135 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 730 137 メルトインデクサー 時間 520 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 2,260 139 溶射皮膜摩耗試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 460 141 ラマン分光光度計 時間 1,060		フーリエ変換赤外分光光度計	時間	
132 プラズマ化学蒸着装置 日 3,260 133 放電プラズマ焼結機 時間 2,380 134 摩擦摩耗試験機 時間 390 135 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 730 137 メルトインデクサー 時間 520 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 2,260 139 溶射皮膜摩耗試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 460 141 ラマン分光光度計 時間 1,060	131	複合サイクル試験機		$2,7\overline{20}$
133 放電プラズマ焼結機 時間 2,380 134 摩擦摩耗試験機 時間 390 135 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 730 137 メルトインデクサー 時間 520 138 ヤグレーザー加エシステム 時間 2,260 139 溶射皮膜摩耗試験機 時間 330 140 溶射皮膜変着力試験機 時間 460 141 ラマン分光光度計 時間 1,060				3,260
134 摩擦摩耗試験機 時間 390 390 335 マスクアライナー 時間 1,000 136 ミクロトーム 時間 520 137 メルトインデクサー 時間 520 138 ヤグレーザー加工システム 時間 2,260 139 溶射皮膜摩耗試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 460 141 ラマン分光光度計 時間 1,060			時間	2.380
135マスクアライナー時間1,000136ミクロトーム時間730137メルトインデクサー時間520138ヤグレーザー加エシステム時間2,260139溶射皮膜摩耗試験機時間330140溶射皮膜密着力試験機時間460141ラマン分光光度計時間1,060			1	~ ~ ~
136 ミクロトーム 時間 730				
137 メルトインデクサー 時間 520 138 ヤグレーザー加工システム 時間 2,260 139 溶射皮膜摩耗試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 460 141 ラマン分光光度計 時間 1,060				
138 ヤグレーザー加工システム 時間 2,260 139 溶射皮膜摩耗試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 460 141 ラマン分光光度計 時間 1,060				
139 溶射皮膜摩耗試験機 時間 330 140 溶射皮膜密着力試験機 時間 460 141 ラマン分光光度計 時間 1,060				
140溶射皮膜密着力試験機時間460141ラマン分光光度計時間1,060				
141 ラマン分光光度計 時間 1,060				
141 フマン分光光度計 時間 1,060 142 レーザー回折式粒度分布測定装置 時間 520	140			
142 レーサー回折式粒度分布測定装置 時間 520	4			
		フマン分光光度計		

	き技術グループ(0836-53-5058)		
143	アイゾット・シャルピー衝撃試験機	時間	550
144	イオンクロマトグラフ水質分析装置	時間	700
145	遠心噴霧式乾燥造粒機	時間	660
146	核磁気共鳴分光器		970
147	ガス吸着量測定装置	時間	720
148	ガスクロマトグラフ質量分析装置(材料系)	時間	2,130
149	ガラスビード作成装置	時間	800
150	蛍光X線分析装置	時間	1,230
151	減容混練圧縮成形機	時間	1,040
152	合成用加圧装置	時間	520
153	高速昇温加熱炉(不活性雰囲気)	時間	710
154	高速昇温加熱炉(酸化雰囲気)	時間	560
155	小型引張圧縮試験機	時間	760

番号	機器名称	単位	使用料
156	ジェットミル	時間	520
157	真空土練成型機	時間	370
158	全窒素分析装置	時間	480
159	全りん分析装置	時間	460
160	総揮発性有機化合物濃度測定器(※)	時間	400
161	脱脂炉	時間	670
162	炭素硫黄同時分析装置	時間	630
163	超臨界処理装置	時間	570
164	ディスクミル	時間	340
165	電気泳動式イオン分析装置	問	570
166	電磁式ふるい振とう機	問	470
167	ニーダー	問	460
168	熱線式熱伝導率測定装置	問	440
169	粉砕試験機	問	410
170	ボールミル	問	400
171	遊星ミル	時間	510
172	落錘式計装化衝擊試験機	時間	520
173	冷間等方加圧装置	時間	740

デサ	Fイングループ(0836-53-5059)		
174	揮発性有機化合物放散測定用小型チャンバー	В	1,180
175	血流画像装置	時間	430
176	コンピューターグラフィクス作成システム	時間	400
177	三次元グラフィクスコンピューター	時間	550
178	3次元点群データ処理装置	時間	490
179	三次元デジタイザー	時間	480
180	樹脂積層式造形機	時間	3,120
181	人工気象室	В	34,250
182	生体計測装置(※)	時間	950
183	赤外線熱画像装置(※)	時間	640
184	切削式3次元モデリング装置	時間	600
185	多数室換気量測定器		1,030
186	デジタルビデオ撮影装置(※)	時間	460
187	分光測色計(デスクトップ)	時間	460
188	分光測色計(ハンディ)(※)	時間	410
189	無線式生体計測装置	時間	820
190	レーザー血流量計	時間	550

食品	技術グループ(0836-53-5060)		
191	ICP発光分析装置	時間	2,240
192	アミノ酸分析装置	試料	1,090
193	液体クロマトグラフ質量分析装置		5,320
194	遠赤外線食品乾燥機		620
195	オートクレーブ	時間	430
196	ガスクロマトグラフ質量分析装置(食品系)	時間	1,310
197	過熱蒸気発生装置	晶晶	570
198	キャピラリー式電気泳動分析装置	晶晶	390
199	クリーンベンチ	晶晶	
200	ケルダール分析装置	バッチ	2,120
201	高速液体クロマトグラフ	時間	490
202	高速溶媒抽出装置	時間	380
203	高速冷却遠心機	時間	500
204	ジャーファーメンター	時間	420
205	食品成分濃縮装置	時間	340
	真空凍結食品乾燥機		2,510
207	真空濃縮装置	時間	620
208	水分活性測定装置	時間	410
209	スプレードライヤー	時間	440
210	生物顕微鏡システム	時間	440
211	ソックスレー抽出器	試料	1,170
212	超微粒粉砕機	時間	410
213	通風乾燥機		600
	電気恒温槽		490
	電気炉		600
216	ドラム式食品乾燥装置	時間	390
217	二軸エクストルーダー	時間	580
218	フレンチプレス	晶	400
219	分光蛍光光度計	晶	340
220	ボールカッター	晶	490
221	マイクロ波加熱分解装置	時間	690
222	レオメーター	時間	460
	レトルト殺菌装置	時間	670
224	連続式殺菌装置	時間	740
225	ロータリーエバポレーター	時間	420

226 小型機器(貧出し用)(※)	l ⊟	1,580
227 JDreamⅡ文献検索端末	_	従量制
使用料の単位は円、(※)は施設外貨	出可	能機器